課題番号	:F-14-OS-0024
利用形態	:機器利用
利用課題名(日本語)	:プラズモニック導波路における光伝搬特性
Program Title (English)	:Optical Propagation Properties of Plasmonic Waveguides
利用者名(日本語)	:高原 淳一
Username (English)	: <u>Junichi Takahara</u>
所属名(日本語)	:大阪大学 大学院工学研究科 精密科学・応用物理学専攻
Affiliation (English)	:Graduate School of Engineering, Osaka University

<u>1. 概要(Summary)</u>

Moore の法則により続く集積回路の微細化トレン ドは 2025 年ごろに物理的な限界に達するとされ、 More than Moore の研究が盛んである。光インターコ ネクションは性能の飛躍的向上に高いポテンシャル を持つとされる。その中でもチップ内の光インターコ ネクションのためのナノオーダーのナノ光導波路が 必要とされている。

プラズモニック導波路は表面プラズモンポラリト ン(Surface Plasmon Polariton: SPP)を用いた光導 波路であり、回折限界を超えるナノオーダー径の光ビ ームを伝送できるので、ナノ光導波路への応用が期待 されている。我々は金属薄膜プラズモニック導波路に 存在する SPP の伝搬モードのうち長距離伝搬モード

(Long-Range Surface Plasmon mode: LRSP) につ いて研究を行ってきた。

本課題はプラズモニック導波路の線幅を小さくし てナノ細線とした場合に LRSP の損失が低下する効 果(Super LRSP)の検証を目的とする。また、プラ ズモニック導波路の伝送損失の低減を目指して、導波 路と半導体量子ドットとのハイブリッド系を用いた SPP 増幅器の基礎特性を調べた。

<u>2. 実験(Experimental)</u>

・利用した主な装置

ナノ薄膜形成システム、集束イオンビーム装置

・実験方法

スラブ導波路を実際に作製しLRSPの伝送を実験的 に試みた。はじめにSiO2膜を堆積させた石英ガラス基 板上に膜厚30nmの銀薄膜を電子ビーム蒸着し、集束 イオンビームを用いて導波路形に加工する。その後、 インデックスマッチングポリマーを塗布して,Fig.1 に示すような対称型スラブ導波路を作製した。構造は 同一置基板上に導波路長Lと幅wを変えて多数作製した。 SPP は非放射モードであり外部光と直接結合しないので、 自由空間から導波路に光を入出力するためのカップラ ーとしてスリットアレイ(幅 630nm,周期 1.26µm)を用 いた。スリット幅と周期はシミュレーションにより最適 化を行っている。

測定は光学顕微鏡下で半導体レーザー(λ₀=635nm) からのガウスビームを対物レンズ(50 倍, NA=0.55) により入力カップラーに集光し、SPP を励起させた。 SPP 伝搬にともなう出力カップラーからの散乱光を同 じ対物レンズによって観測した。入力カップラーでは強 い後方散乱が起きるためにLが短い場合は出力光が覆い 隠されてしまう。そこで Fig.2(a)に示すようにクロス偏 光法を利用して入射偏光と出力偏光を直交させ,入出力 を分離した。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

線幅が十分大きい w=5µm の導波路 (Fig.1(a)) の長さ を変化 (*L*=15~60µm) させて出力光強度を観測し、プ ロットしたものを Fig.2(b)に示す。Fig.2(b)においてフィ ッティングから求めた伝搬距離は 43.0µm であり、この 値は有限要素法の計算から求めた LRSP の伝搬距離の 理論値 42.4µm と良く一致している。このことから LRSP が励起され、伝搬していることが確認できたとい える。

次に、Fig. 1(b)に示すようにスラブ導波路幅を波長以 下 w = 200、300、500nm と変化させたナノ細線の出力 光強度を観測した。その結果、線幅を小さくするほど出 力光強度の増強がみられた。線幅が $w < \lambda_0$ の領域になる と両端の影響により LRSP よりは左右の SPP が結合し た ss_0 モードが支配的な領域となることがモード解析か らわかっている。この結果は ss_0 モードの伝搬距離が薄 膜を伝搬する LRSP より長いことを示している。我々は ssoモードを LRSP より低損失という意味で超長距離 伝搬モード(Super LRSP)と名付けているが、Super LRSPの観測に成功したといえる。



Fig.1 The optical microscope image of silver slab waveguide with $w = 5 \mu m$ (a) and w = 200 nm (b). The dark and the blight part indicate SiO₂ substrate and silver film, respectively.



Fig. 2 (a) The optical microscope image of excitation, propagation along a slab waveguide and scattering from the output coupler. Arrows indicate polarization direction of the input and output. (b) Intensity of output versus L at $\lambda_0=635$ nm: experimental results (red squares) and the exponential fitting (solid line). Error bars indicate ±1 standard deviation.

この他にも我々は銀薄膜構造上にアルミナ層を介 して半導体量子ドット(CdSe/SnS)を堆積させる方 法により、プラズモニック導波路と量子ドットとのハ イブリッド系の構築に成功している。今回はこの技術 を利用して LRSP の増幅実験を試みた。本手法は量子 ドットをポリマー中に希釈した先行研究と比べて、量 子ドットの密度が高いことが特徴である。実験の結果、 532nm のポンプ光の照射条件下でのみ 633nm の LRSP 信号が検出され、ポンプ光がない場合は損失のため信号 は検出されなかった。このことから伝送損失の低減が観 測されたといえる。

<u>4. その他・特記事項(Others)</u> なし

<u>5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)</u>

 M. Higuchi *et al.*, Proceedings of SPIE 9163, 91632V-1-6 (2014).

 M. Miyata *et al.* Opt. Express Vol. 22, No. 10, (2014) pp.11399-11406.

3) Tianji Liu and Junichi Takahara, Optics & Photonics Japan 2014, 6pP4, November 6, 2014.

4) 長崎裕介他:第 62 回応用物理学会春季学術講演会13a-A12-5 平成 27 年 3 月 13 日.

6. 関連特許(Patent)

なし